

【目的】 透過電子顕微鏡観察を行う際の装置立ち上げ、試料導入や観察について一通りの作業と技術を習得する。透過電子顕微鏡の動作原理、排気系統や電子光学系、各種電子線源などの基礎知識を学習する。

【日程】 2024年6月18日（火）、19日（水）

【装置】 JEM-2100F（日本電子）

【講師】 日本電子株式会社 沢登様

【場所】 日本電子株式会社 開発館（東京都昭島市）

【開催】 対面

【内容】 6月18日（火）	10:00 ～ 11:00	講義「透過電子顕微鏡の基礎」
	11:10 ～ 12:00	実習 低倍率像の撮影
	(12:00 ～ 13:00 昼休み)	
	13:00 ～ 14:00	実習 低倍率像の撮影
	14:10 ～ 16:00	実習 高倍率像の撮影
6月19日（水）	10:00 ～ 11:00	講義「電子回折と STEM・EDS」
	11:10 ～ 12:00	実習 制限視野電子回折法
	(12:00 ～ 13:00 昼休み)	
	13:00 ～ 14:30	実習 STEM
	14:40 ～ 16:00	実習 EDS



JEM-2100F
日本電子HPより引用